

平成 28 年度装置開発技術系講習会報告

福 森 勉

工学系技術支援室 装置開発技術系

はじめに

今年度の装置開発技術系講習会は、実験実習工場と赤崎記念館装置開発ファクトリーに所有している表面粗さ測定器、マイクロスコープ、三次元測定機の3つの測定機器の使い方について技術系講習会を開催した。参加者は当技術系のみで講師3名、受講者13名であった。各測定器の特徴や操作方法についてベテラン技術職員から若手職員へ指導することを目的とし、簡易操作マニュアルの作成もおこなった。

開催内容は以下の通りである。

講習題目：測定器の使い方

開催日時：平成 27 年 10 月 7 日（金）13:00～15:00

開催場所：実験実習工場、赤崎記念館装置開発ファクトリー

講 師：長谷川達郎、白木尚康、山本浩治

参加人数：装置開発技術系 13 名

1. 表面粗さ測定器

機種：MITUTOYO SURFTTEST SJ-21（図.1）

概要：本体、プリンター、粗さ標準片、スライタスから構成され、様々な部品の表面を検出器でトレースし、粗さ規格に基づいて表面粗さを演算し表示する現場型の表面粗さ測定器である。粗さの JIS 規格の定義や操作方法について講習を行い、ワイヤ放電加工、ミーリングカッター、サンドブラストなどの加工材料で比較測定を試みた。



図 1. 表面粗さ測定器

2. 三次元測定機

機種：MITUTOYO Crysta-Plus M443（図.2）

概要：起動方法から専用ソフトの操作方法について基本的な講習を行った。実際に外径、内径、穴径、円筒形状、輪郭形状について測定を実施し操作方法の習得を試みた。



図 2. 三次元測定機

3. マイクロスコープ

機種：Microscope FS1400（図.3）

概要：本体、PC から構成される。起動方法や専用ソフトの操作について説明をおこなった。



図 3. マイクロスコープ